パイプ加工特集

4－5面

内部に流体（気体、液体、粉体）を通し輸送するために用いる配管。その中心的な役割を担うのが円形断面かつ中空の部材で、継手・フランジ・バルブ・計器などの部品とともに配管を構成する。配管の用途は多岐にわたり、建物内部の給排水や空調設備、上下水道やガスなどの生活インフラ、各種プラントまで人々の暮らしや都市機能を維持する上で欠かせない設備だ。管の材料は寸法表記に内径ベースの呼び径（インチ）を使う「パイプ」、外径ベースのミリやインチを使う「チューブ」に分けられるが、本稿では便宜上、配管材の呼称を「パイプ」に統一する。特集ではパイプ溶接に焦点を当て、配管製作の現場ルポや関連する新技術・製品を掲載する。

配管製作にパイプ自動溶接機が活躍
需要急伸受け自動溶接機の増設を計画
IKK東北（岩手）

菅野社長

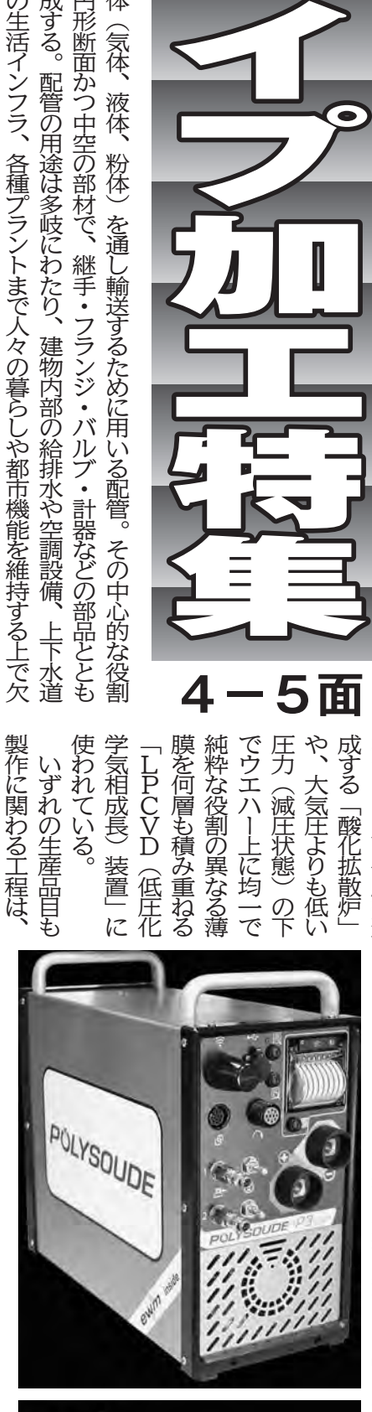
IKK東北（岩手県奥州市、菅野新一社長）は半導体製造装置（酸化拡散炉、LPCVD装置）向けにガス配給ユニット用配管部品やガスボックス用IGS（集積ガスシステム）の製作を手がけている。ガス配給ユニット用では主に小径・薄肉ステンレス鋼管の溶接工程に複数のパイプ自動溶接機を駆使して効率よく安定した品質の製品・部品をつくり続けており、顧客からの信頼も厚い。2年前には親会社がミラプロ ノロジーソリューションズ（TTS）を中心に半導体製造装置関連

クリーンルーム内での溶接施工の様子

◇　◇

■会社の沿革

IKK東北は岩手県の内陸南部に位置する奥州市の江刺中核工業団地内に拠点を構え、周辺には主要取引先の半導体製造装置メーカーで東京エレクトロン（TEL）の子会社、東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ（TTS）を中心に半導体製造装置関連


POLYSOUDE社の溶接電源「P3」と溶接ヘッドUHP500

増設して供給能力を約倍増するなど経営基盤の強化も進めている。

このほど同社を訪れ、半導体需要の増加で活気づくものづくり現場を取材した。

◇　◇

■会社の沿革

IKK東北は岩手県の内陸南部に位置する奥州市の江刺中核工業団地内に拠点を構え、周辺には主要取引先の半導体製造装置メーカーのミラプロが東北地方に進出したのに伴い、24年からその子会社の製品のみをつくり続けている。

■主にガス供給系製品を生産

同社の主要生産品目はガス配給ユニット部品およびIGSなどの半導体製造装置向け高純度ガス供給系製品。半導体製造装置の前工程でウエハー表面に均一な

ともに、半導体市場が急成長していることもあって企業として新たな飛躍の時期を迎え、クリーンルームを増設するなど経営基盤の強化も進めている。

このほど同社を訪れ、半導体需要の増加で活気づくものづくり現場を取材した。

◇　◇

■会社の沿革

IKK東北は岩手県の内陸南部に位置する奥州市の江刺中核工業団地内に拠点を構え、周辺には主要取引先の半導体製造装置メーカーのミラプロが東北地方に進出したのに伴い、24年からその子会社の製品のみをつくり続けている。

■主にガス供給系製品を生産

同社の主要生産品目はガス配給ユニット部品およびIGSなどの半導体製造装置向け高純度ガス供給系製品。半導体製造装置の前工程でウエハー表面に均一な

場が急成長している。元々、奥州市（旧江刺市）に進出しようとしていたTELの誘いに応じ、当時の親会社である愛知県東海市の鋳物メーカー、伊藤機工の関連会社として1995年4月に設立。その後、半導体製造装置関連部品メーカーのミラプロが東北地方に進出したのに伴い、24年からその子会社の製品のみをつくり続けている。

■主にガス供給系製品を生産

同社の主要生産品目はガス配給ユニット部品およびIGSなどの半導体製造装置向け高純度ガス供給系製品。半導体製造装置の前工程でウエハー表面に均一な

なシリコン酸化膜を形成する「酸化拡散炉」や、大気圧よりも低い圧力（減圧状態）の下でウエハー上に均一で純粋な役割の異なる薄膜を何層も積み重ねる「LPCVD（低圧化学気相成長）装置」に使われている。

いずれの生産品目も製作に関わる工程は、FED規格（アメリカ連邦規格）のクラス1000に位置付けられる清浄度が高いクリーンルーム（一部はクラス100のクリーンブース）内で作業が行われる。クラス1000の清浄度はISO規格のクラス6に相当するもので、1立方フィート（約28㍑）の空気中に含まれる「0・5ミクロン以上」の微粒子数が1000個（クラス100であれば同100個）という厳しい基準をクリアしなければならない。

同社は工場内にクリーンルームを3個所設け、半導体製造装置向けに高純度ガスを供給する配管部品の切断、曲げといった一次加工を行う配管加工ルーム、一次加工を終えた部品の溶接施工を行う配管溶接ルーム、IGS組立ルームとして使用。それぞれの床面積（前室、更衣室を除く）は、配管加工ルームが84平方㍍、配管溶接ルームは115・2平方㍍、昨年増設されたばかりのIGSルーム

ムは163・8平方㍍。これらの施設でステンレス鋼配管を月間約5000本、IGSを同40―50台製作している。

■パイプ溶接に複数の自動溶接機を活用

半導体ウエハーの製造工程では塩素系やシラン系といった腐食性の強いガスが使用されるため、ガス供給系配管は比較的耐食性の高いSUS316Lなどのステンレス鋼管（パイプ）を母材とし、同社では主に日本製鉄の半導体製造用クリーンパイプ「NSCP」（JIS規格のSUS316Lよりも厳格な基準で成分管理された製品）を使用している。同社が扱う配管のサイズは外径が4分の1㌅（6・35㍉）、3分の8㌅（9・53㍉）、2分の1㌅（12・7㍉）の3種で、肉厚は4分の1㌅と3分の8㌅のパイプが1・0㍉、2分の1㌅のパイプが1・24㍉。これらの溶接は半導体製造に悪影響を及ぼすパーティクル（微粒子不純物）を一定数以下に除

去したクリーンルーム内の清浄な環境下で行われる。

半導体製造装置に用いられるSUSパイプの溶接方法はI形開先の突合せ完全溶込みの片面裏波溶接となり、とくに小径・薄肉ものの溶接ではティグ溶接用の自動機が広く普及。外径はUHP500の適用外径は3―12・7㍉（1/8㌅―1/2㌅）で、これ一つでIKKと、これ一つでIKKが製作する配管の全サイズをカバーする。UHPシリーズはシールド性が高いクローズド型溶接ヘッドで半導体などの薄肉管の円周溶接に適しており、フィラーワイヤーなしでの高品質な溶接を実現。ガス供給系の生命線である高純度ガス配管にとって重大な溶接欠陥となる溶込み不良や溶接線のズレ、裏ビードの高さ不足や溶接ビードの蛇行などが出にくいことがこれらのパイプ自動溶接機を長年使い続けてきた理由だ。

適正な溶接条件により配管内側の溶接部に酸化焼けがなく段差のないフラットな裏波溶接を行うことが、半導体の製造に影響しかね

ムは163・8平方㍍。これらの施設でステンレス鋼配管を月間約5000本、IGSを同40―50台製作している。

■パイプ溶接に複数の自動溶接機を活用

半導体ウエハーの製造工程では塩素系やシラン系といった腐食性の強いガスが使用されるため、ガス供給系配管は比較的耐食性の高いSUS316Lなどのステンレス鋼管（パイプ）を母材とし、同社では主に日本製鉄の半導体製造用クリーンパイプ「NSCP」（JIS規格のSUS316Lよりも厳格な基準で成分管理された製品）を使用している。同社が扱う配管のサイズは外径が4分の1㌅（6・35㍉）、3分の8㌅（9・53㍉）、2分の1㌅（12・7㍉）の3種で、肉厚は4分の1㌅と3分の8㌅のパイプが1・0㍉、2分の1㌅のパイプが1・24㍉。これらの溶接は半導体製造に悪影響を及ぼすパーティクル（微粒子不純物）を一定数以下に除

ないパーティクル（微粒子不純物）を一定数以下に除

去したクリーンルーム内の清浄な環境下で行われる。

半導体製造装置に用いられるSUSパイプの溶接方法はI形開先の突合せ完全溶込みの片面裏波溶接となり、とくに小径・薄肉ものの溶接ではティグ溶接用の自動機が広く普及。外径はUHP500の適用外径は3―12・7㍉（1/8㌅―1/2㌅）で、これ一つでIKKと、これ一つでIKKが製作する配管の全サイズをカバーする。UHPシリーズはシールド性が高いクローズド型溶接ヘッドで半導体などの薄肉管の円周溶接に適しており、フィラーワイヤーなしでの高品質な溶接を実現。ガス供給系の生命線である高純度ガス配管にとって重大な溶接欠陥となる溶込み不良や溶接線のズレ、裏ビードの高さ不足や溶接ビードの蛇行などが出にくいことがこれらのパイプ自動溶接機を長年使い続けてきた理由だ。

適正な溶接条件により配管内側の溶接部に酸化焼けがなく段差のないフラットな裏波溶接を行うことが、半導体の製造に影響しかね

ないパーティクル溜まりや圧力損失を防止するうえで不可欠。こうした成膜装置の同地での生産能力が最大1・5倍を増やすなど製造装置の供給体制を整えているという。直近ではTSMC熊本工場や中国の先端半導体メーカー向けに製造装置の出荷が好調で、今後さらに増加する勢いだ。27年度後半以降、次世代半導体の量産開始を目指すラピダスのパイプ自動溶接機全サイズをカバーする。UHPシリーズはシールド性が高いクローズド型溶接ヘッドで半導体などの薄肉管の円周溶接に適しており、フィラーワイヤーなしでの高品質な溶接を実現。ガス供給系の生命線である高純度ガス配管にとって重大な溶接欠陥となる溶込み不良や溶接線のズレ、裏ビードの高さ不足や溶接ビードの蛇行などが出にくいことがこれらのパイプ自動溶接機を長年使い続けてきた理由だ。

適正な溶接条件により配管内側の溶接部に酸化焼けがなく段差のないフラットな裏波溶接を行うことが、半導体の製造に影響しかね

ないパーティクル溜まりや圧力損失を防止するうえで不可欠。こうした成膜装置の同地での生産能力が最大1・5倍を増やすなど製造装置の供給体制を整えているという。直近ではTSMC熊本工場や中国の先端半導体メーカー向けに製造装置の出荷が好調で、今後さらに増加する勢いだ。27年度後半以降、次世代半導体の量産開始を目指すラピダスのパイプ自動溶接機全サイズをカバーする。UHPシリーズはシールド性が高いクローズド型溶接ヘッドで半導体などの薄肉管の円周溶接に適しており、フィラーワイヤーなしでの高品質な溶接を実現。ガス供給系の生命線である高純度ガス配管にとって重大な溶接欠陥となる溶込み不良や溶接線のズレ、裏ビードの高さ不足や溶接ビードの蛇行などが出にくいことがこれらのパイプ自動溶接機を長年使い続けてきた理由だ。

適正な溶接条件により配管内側の溶接部に酸化焼けがなく段差のないフラットな裏波溶接を行うことが、半導体の製造に影響しかね

ないパーティクル溜まりや圧力損失を防止するうえで不可欠。こうした成膜装置の同地での生産能力が最大1・5倍を増やすなど製造装置の供給体制を整えているという。直近ではTSMC熊本工場や中国の先端半導体メーカー向けに製造装置の出荷が好調で、今後さらに増加する勢いだ。27年度後半以降、次世代半導体の量産開始を目指すラピダスのパイプ自動溶接機全サイズをカバーする。UHPシリーズはシールド性が高いクローズド型溶接ヘッドで半導体などの薄肉管の円周溶接に適しており、フィラーワイヤーなしでの高品質な溶接を実現。ガス供給系の生命線である高純度ガス配管にとって重大な溶接欠陥となる溶込み不良や溶接線のズレ、裏ビードの高さ不足や溶接ビードの蛇行などが出にくいことがこれらのパイプ自動溶接機を長年使い続けてきた理由だ。

適正な溶接条件により配管内側の溶接部に酸化焼けがなく段差のないフラットな裏波溶接を行うことが、半導体の製造に影響しかね